

LIFTING DEVICE, SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS
HAVING LIFTING DEVICE, AND UNIT TRANSFERRING METHOD

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基板処理装置の大きさに関わらず高さレベル調整を容易に行う。

【解決手段】 昇降装置 630b は、複数のユニットを組み立てて構成される基板処理装置の少なくとも 1 つのユニットと該ユニットの設置面との間に設けられ、設置面に対する少なくとも 1 つのユニットの高さを調整するための昇降機構 640 と、昇降機構 640 から延伸する延伸部 664 を有し、延伸部 664 を介して昇降機構 640 を操作可能な調整部材 660 と、を備える。

【選択図】 図 6